Searching PA'1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-252618

(43) Date of publication of application: 09.09.1994

(51)Int.CI.

H01P 11/00 CO4B 35/64 CO4B 37/00

HO1P 1/203 HO1P 7/08 H05K 3/46

(21)Application number: 05-267971

(71)Applicant:

TDK CORP

(22)Date of filing:

30.09.1993

· (72)Inventor:

SUZUKI KAZUAKI

FURUBAYASHI MAKOTO

MIURA TARO KAWAMURA KEIZO

(30)Priority

Priority number: 04361377

Priority date: 28.12.1992

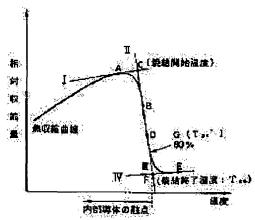
Priority country: JP

(54) MULTI-LAYER CERAMIC COMPONENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve the characteristic such as Q value by forming an internal pattern onto a specific dielectric ceramic material layer, laminating the layer onto a dielectric ceramic material layer and baking the laminated component at a temperature over the melting point of an inner conductor and below the boiling point.

CONSTITUTION: The multi-layer ceramic component is manufactured by forming an inner conductor pattern onto a green sheet made of a dielectric ceramic material, laminating green sheets, pressing through hot press and baking the pressed sheets. In this case, the dielectric ceramic material whose sintering end temperature obtained by a thermal contraction curve at a temperature rising rate of 200° C/hour is temperature over the melting point of the inner conductor. The sintering end temperature is a cross point F between tangential lines III, IV in the thermal contraction curve of the ceramic material. Thus, the structure of the inner conductor is made tight, the contact state of the conductor is improved and the Q value is enhanced.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

09.06.1997

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2858073

04.12.1998 [Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-252618

(43)公開日 平成6年(1994)9月9日

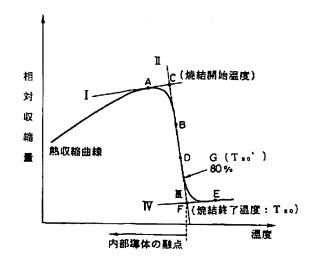
(51) Int. C1. ⁵		識別記号	庁内整理番	号	FΙ		技術表示箇所
H 0 1 P	11/00	G	r				
C 0 4 B	35/64	G	r F				
	37/00	C	;				
H 0 1 P	1/203						
	7/08						
	審査請求	未請求 請求	は項の数10	FD		(全15頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特』	顏平5−267971			(71)出願人	000003067	
						ティーディーケイ株式会社	生
(22)出願日	平月	成5年(1993)9月	30日			東京都中央区日本橋1丁目	13番1号
					(72)発明者	鈴木 和明	
(31)優先権主張	番号 特別	類平4−361377				東京都中央区日本橋一丁	∃13番1号 ティ
(32)優先日	平4	1(1992)12月28	日			ーディーケイ株式会社内	
(33)優先権主張	国 日	本(JP)			(72)発明者	古林 眞	
						東京都中央区日本橋一丁	目13番1号 ティ
						ーディーケイ株式会社内	
					(72)発明者	三浦 太郎	
						東京都中央区日本橋一丁	目13番1号 ティ
						ーディーケイ株式会社内	
					(74)代理人	弁理士 石井 陽一	
							最終頁に続く

(54) 【発明の名称】多層セラミック部品

(57)【要約】

【目的】 Q値等の特性の向上を図ることができ、さらに、焼成時に内部導体層と誘電体セラミック材料層との 剥離による不良品や、内部導体層の断線等の発生が少な い共振器等の多層セラミック部品を提供する。

【構成】 昇温速度200℃/時間における熱収縮曲線から求めた焼結終了温度が内部導体の融点以上沸点以下の温度であり、誘電率および誘電損失(Q・f)に優れた酸化物の誘電体セラミック材料層上に内部導体のパターンを形成し、積層後、内部導体の融点以上の温度で焼成する。このとき内部導体が銀で、最外層に誘電体セラミック層を有し、内部導体の最外層側表面から誘電体セラミック層最外層表面までの距離が500μm以下の場合、あるいは内部導体が銅の場合、雰囲気中の酸素分圧を制御して焼成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 内部導体層と複数の誘電体セラミック層 とを有する多層セラミック部品であって、

昇温速度200℃/時間における熱収縮曲線から求めた 焼結終了温度が内部導体の融点以上沸点以下の温度であ る酸化物の誘電体セラミック材料の誘電体セラミック材 料層を用意し、

この誘電体セラミック材料層上に内部導体のパターンを 形成し、さらにこれを前記誘電体セラミック材料層と積 層し、

前記内部導体の融点以上の温度で焼成して得られた多層 セラミック部品。

【請求項2】 前記焼成温度が、前記焼結終了温度以上 の温度である請求項1の多層セラミック部品。

【請求項3】 前記誘電体セラミック材料の温度20℃ における比誘電率 ε が、6. 5~120である請求項1 または2の多層セラミック部品。

【請求項4】 前記誘電体セラミック材料が、MgO-SiO₂ 系、CaO-MgO-TiO₂ 系、BaO-T i O₂ - S n O₂ 系、B a O - M g O - C o O - N b₂ O5 系、BaO-Nd2 O3 - TiO2 - Bi2 O3 -Al₂O₃-MnO系、BaO-MgO-Ta₂O₅ 系、ZrO2-SnO2-TiO2系、PbO-CaO -ZrO₂系、SrO-ZrO₂-TiO₂系、BaO -Sm₂O₅ -TiO₂ 系、PbO-BaO-Nd₂O₃ -TiO2 系およびLi2 O-Na2 O-Sm2 O5 - T i O₂ 系のいずれかである請求項1~3のいずれか の多層セラミック部品。

【請求項5】 前記内部導体を構成する金属は、銀また は銅の含有量が90wt%以上のものである請求項1~4 30 のいずれかの多層セラミック部品。

【請求項6】 前記内部導体を構成する金属が銀であ り、1×10⁻¹atm 以下の酸素分圧下で焼成して得られ た請求項1~5のいずれかの多層セラミック部品。

【請求項7】 最外層に誘電体セラミック層を有し、前 記内部導体層の前記最外層側表面から前記最外層表面ま での距離が500μm以下である請求項6の多層セラミ ック部品。

【請求項8】 前記誘電体セラミック材料が、CaO-MgO-TiO2系、BaO-TiO2-SnO2系、 $B\ a\ O\ -\ N\ d\ _{2}\ O_{3}\ -\ T\ i\ O_{2}\ -\ B\ i\ _{2}\ O_{3}\ -\ A\ l\ _{2}\ O_{3}$ -MnO系、BaO-MgO-Ta₂O₅系、ZrO₂ $-SnO_2-TiO_2$ 系、 $SrO-ZrO_2-TiO_2$ 系、BaO-Sm2 O5-TiO2系、PbO-BaO -Nd2O3-TiO2系およびLi2O-Na2O-Sm₂ O₅ -TiO₂ 系、のいずれかであり、1×10 -4atm を超え、1×10⁻¹atm 以下の酸素分圧下で焼成 して得られた請求項6または7の多層セラミック部品。

【請求項9】 前記内部導体を構成する金属が銅であ

た請求項1~5のいずれかの多層セラミック部品。

【請求項10】 誘電体セラミック材料が、MgO-S i O₂ 系、B.a O-Mg O-CoO-Nb₂ O₅ 系およ びPbO-CaO-ZrO2系のいずれかである請求項 9の多層セラミック部品。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、主にマイクロ波領域で 使用される誘電体共振器やフィルターなどの多層セラミ 10 ック部品に関する。

[0002]

【従来の技術】多層セラミック部品、例えば誘電体共振 器の使用周波数領域が拡大するにつれて、特にマイクロ 波領域において使用される誘電体共振器等の小型化が望 まれている。このような要請からマイクロ波用誘電体セ ラミック材料が種々開発されており、特に小型化を実現 するものとして高誘電率を示すことが要求される。

【0003】また、共振特性をさらに高いものとするた めに、マイクロ波に適したAg、Cu等の導体材料を内 部電極として用い、セラミック材料を積層する方法が採 用されている。共振器等の多層セラミック部品を作製す る場合、グリーンシート法や積層印刷法が用いられてお り、導体材料とセラミック材料とを同時焼成する方法が 採用されている。

【0004】従来、このような方法により十分な特性を 得るためには、内部導体材料の溶融を防止する必要があ ると考えられており、内部導体材料の融点以下の温度で 焼成する必要があるとされていた。このため、高温で焼 成する必要のあるセラミック材料は、高誘電特性を示す ものであっても使用できないとされていた。この結果、 低温焼成可能な誘電体セラミック材料については種々の 提案がなされている(特開平3-295854号、特開 平3-295855号、特開平3-295856号、特 開平3-295858号、特開平3-295859号公 報等)。

【0005】しかし、上記の従来法に対し、種々検討を 加えたところ、本発明者らは、内部導体材料の融点以上 の温度で同時焼成することにより、内部導体が溶融して 緻密化し、導体粉によって生じる内部導体内の粒界を実 40 質的に消滅させることができ、共振器としてのQ値を向 上するなど、特性の向上を図ることができることを見い 出しており、種々の提案を行なっている(特願平3-3 06760号、同4-134199号、同4-1464 78号、同3-360323号、同4-313997

【0006】ただし、これらに用いられているのは低温 焼成用のセラミック材料であり、このようなセラミック 材料を用いて上記の内部導体を溶融して焼成する場合、 内部導体の表面性が良好でないためか、種々の要因に起 り、1×10⁻⁻⁶atm 以下の酸素分圧下で焼成して得られ 50 因して特に共振器としてのQ値が低下しやすいという問 題があり、この点の改善が望まれている。

【0007】なお、特開平2-197189号公報で は、金、銀、銅のうちの1種以上を用いて内部導体を形 成した窒化アルミニウム回路基板を焼成することが提案 されている。窒化アルミニウム回路基板の最適な焼成温 度は、上記内部導体の溶融温度以上であり、これらの内 部導体は焼成時に実質的に溶融する。この提案では、窒 化アルミニウムのもつ濡れ性の悪さ、緻密化速度の早さ 等を利用して、金、銀、銅のような比較的溶融温度の低 い内部導体材料を用いても、窒化アルミニウム回路基板 10 は(2)の多層セラミック部品。 に内部配線材料として導体回路を形成することができた としている。そして、この際、本発明におけると同様の 溶融による内部導体の緻密化が生じていると考えられ る。

【0008】しかし、例えば共振器等の高周波(例えば 200MHz ~10GHz 程度の周波数) 用の多層セラミッ ク部品をこのような窒化アルミニウムを用いて製造した 例はない。小型化が望まれている高周波用の部品におい て、一般に窒化アルミニウムのような比較的誘電率の低 い材料は使用しにくく、使用しても大型化してしまう。 さらに、窒化アルミニウムは溶融金属に対しての濡れ性 が悪い。このため、内部導体の緻密化は生じるが、その 界面等には欠陥が生じやすく、はなはだしいときには導 体パターンの狭窄や断線が生じる。小型化が求められて いる高周波用等の部品では、誘電体層の薄層化ととも に、内部導体層の厚さや幅も、薄層化、狭小細線化が求 められており、特に薄層化、狭小細線化をしようとする 場合には内部導体層の断線等の欠陥の発生が顕在化す る。

【0009】また、内部導体として特に銀を用い、誘電 30 体セラミック材料として酸化物を用い、さらに内部導体 と部品表層面との間の誘電体セラミック材料層の厚さが 薄い積層複合部品等の焼成に際して、内部導体と誘電体 セラミック材料層とが剥離する不良品が多数発生する。 [0010]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、誘電 率および誘電損失(Q・f)に優れた誘電体セラミック 材料を用い、かつ内部導体を緻密化し、しかも表面性を 良好にすることができる結果、Q値等の特性の向上を図 ることができ、さらに、焼成時に内部導体層と誘電体セ 40 ラミック材料層との剥離による不良品や、内部導体層の 断線等の発生が少ない多層セラミック部品を提供するこ とにある。

[0011]

【課題を解決するための手段】このような目的は、下記 (1)~(10)の本発明により達成される。

(1) 内部導体層と複数の誘電体セラミック層とを有 する多層セラミック部品であって、昇温速度200℃/ 時間における熱収縮曲線から求めた焼結終了温度が内部 導体の融点以上沸点以下の温度である酸化物の誘電体セ 50

ラミック材料の誘電体セラミック材料層を用意し、この 誘電体セラミック材料層上に内部導体のパターンを形成 し、さらにこれを前記誘電体セラミック材料層と積層 し、前記内部導体の融点以上の温度で焼成して得られた 多層セラミック部品。

- 前記焼成温度が、前記焼結終了温度以上の温度 (2) である上記(1)の多層セラミック部品。
- 前記誘電体セラミック材料の温度20℃におけ る比誘電率 ε が、6.5~120である上記(1)また
 - 前記誘電体セラミック材料が、MgO-SiO (4) 2 系、CaO-MgO-TiO2系、BaO-TiO2 -SnO₂ 系、BaO-MgO-CoO-Nb₂ O₅ 系、BaO-Nd2O3-TiO2-Bi2O3-Al 2 O3 -MnO系、BaO-MgO-Ta2 O5 系、Z rO2-SnO2-TiO2系、PbO-CaO-Zr O2 系、SrO-ZrO2 -TiO2 系、BaO-Sm 2 O5 - TiO2 系、PbO-BaO-Nd2 O3 - T i O2 系およびLi2 O-Na2 O-Sm2 O5 -Ti O₂ 系のいずれかである上記(1)~(3)のいずれか の多層セラミック部品。
 - (5) 前記内部導体を構成する金属は、銀または銅の 含有量が 9 0 wt %以上のものである上記 (1) ~ (4) のいずれかの多層セラミック部品。
 - (6) 前記内部導体を構成する金属が銀であり、1× 10⁻¹atm 以下の酸素分圧下で焼成して得られた上記
 - (1)~(5)のいずれかの多層セラミック部品。
- (7) 最外層に誘電体セラミック層を有し、前記内部 導体層の前記最外層側表面から前記最外層表面までの距 離が500 μm 以下である上記(6)の多層セラミック 部品。
- (8) 前記誘電体セラミック材料が、CaO-MgO -TiO2系、BaO-TiO2-SnO2系、BaO -Nd₂ O₃ -TiO₂ -Bi₂ O₃ -Al₂O₃ -M nO系、BaO-MgO-Ta2 O5 系、ZrO2-S nO₂-TiO₂系、SrO-ZrO₂-TiO₂系、 BaO-Sm₂O₅-TiO₂系、PbO-BaO-N d₂ O₃ -TiO₂ 系およびLi₂ O-Na₂ O-Sm 2 O₅ - TiO₂ 系、のいずれかであり、1×10⁻⁴at m を超え、1×10⁻¹atm 以下の酸素分圧下で焼成して 得られた上記(6)または(7)の多層セラミック部 品。
- 前記内部導体を構成する金属が銅であり、1× (9) 10⁻⁶atm 以下の酸素分圧下で焼成して得られた上記 (1)~(5)のいずれかの多層セラミック部品。
- (10) 誘電体セラミック材料が、MgO-SiO₂ 系、BaO-MgO-CoO-Nb2 O5 系およびPb O-CaO-ZrO₂ 系のいずれかである上記(9)の 多層セラミック部品。

[0012]

【具体的構成】以下、本発明の具体的構成について詳細 に説明する。

【0013】本発明の多層セラミック部品は、誘電体セ ラミック材料のグリーンシート上に内部導体パターンを 形成した後、このグリーンシートを積層して、熱プレス にて圧着し、その後焼成して製造される。このようない わゆるグリーンシート法の他、誘電体のペーストと内部 導体のペーストとを交互に積層するいわゆる印刷積層法 を用いてもよい。

/時間における熱収縮曲線から求めた焼結終了温度が内 部導体の融点以上沸点以下の温度である誘電体セラミッ ク材料を用い、内部導体の融点以上の温度で焼成してい る。すなわち、本発明に用いる誘電体セラミック材料 は、いわゆる高温焼成用のものであり、焼成に伴ない内 部導体が溶融するとともに、セラミック材料が焼結体を 形成するところに本発明の特徴がある。従って、本発明 では、内部導体の融点以上の温度であって、かつセラミ ック材料の焼結終了温度以上の温度で焼成する。

【0015】本発明にいう「焼結終了温度」とは、理論 20 的にセラミック材料が焼結体を形成する温度を指し、後 述のように熱収縮曲線から求められるものである(後記 図1参照)。

【0016】本発明における焼結終了温度は、上記のよ うに、内部導体の融点以上の温度であり、好ましくは内 部導体の融点+50℃以上、さらに好ましくは内部導体 の融点+100℃以上、特に好ましくは内部導体の融点 +150℃以上の温度である。また、後述の熱収縮曲線 から求められる焼結開始温度(図1:点C)と焼結終了 温度T₂₀(図1:点F)間において点Cから80%のと 30 ころに相当する温度T20'(図1:点G)が、内部導体 の融点以上の温度が好ましく、さらには内部導体の融点 +20℃以上の温度が好ましく、特に内部導体の融点+ 50℃以上の温度であることが好ましい。また、あまり に蒸気圧が高くなるほどの高温となると内部導体が蒸発 してしまうので、焼結終了温度の上限は、上記のように 内部導体の沸点以下とする。通常、焼結終了温度は96 0~1900℃、好ましくは1100~1700℃程度 である。なお、上記における内部導体の融点、沸点は、 内部導体金属(合金も含む。)の融点、沸点であり、通 40 常バルク状態で求められたものである。

【0017】また、実際の焼結温度は焼結終了温度以上 の温度とする。ただし、この関係は、実際の焼成温度に 到達するまでの昇温速度と同条件とした熱収縮曲線から 求めた焼結終了温度との間で成立するものである。ま た、上記の200℃/時間の昇温速度は、通常の焼成時 に適用されるものである。同じ昇温速度とした場合にお いて、実際の焼成温度T2は、焼結終了温度T20と同じ か、これより70℃程度高い温度までの範囲の温度とな る。従ってT₂、T₂₀および内部導体の融点mpは、m 50

p≤T₂₀≤T₂ の関係にあることが好ましい。

【0018】このように、本発明の多層セラミック部品 は、誘電体セラミック材料として内部導体の融点以上の 温度で焼結するものを用い、誘電体セラミック材料の焼 結終了温度以上の温度で焼成しているので、内部導体か ら焼成時に発生するガスを誘電体セラミック材料層外に 排出することができる。従って、表面に凹凸がなく、表 面状態が良好な内部導体を形成することができる。この ため、共振器としてのQ値等の特性が高くなる。なお、 【0014】この場合、本発明では、昇温速度200℃ 10 このとき発生するガスは焼成時に発生するもので、例え ばバインダや溶剤等のビヒクルに由来して発生する炭酸 ガスや水分等のガスである。

6

【0019】また、従来、誘電体セラミック材料層と内 部導体を積層して同時焼成する方法を採用する場合、内 部導体の溶融を防止するため、内部導体の融点より高い 温度で焼結するセラミック材料は用いることができない とされており、誘電率およびQ・f値に優れた材料であ っても焼成温度が高いため用いることができないとされ ていた(特開平3-290358号等)。しかしなが ら、本発明では、内部導体を溶融状態とすることによっ て、内部導体の構造を緻密化し、導体の接触状態を改善 し、線路の損失を低減させ、共振器としてのQ値を向上 させる効果を得ている。このため、焼結温度が高く、か つ誘電率およびQ・f値に優れたセラミック材料を用い ることができ、セラミック材料自体の高特性を生かすこ とができ、共振器としてのQ値を高くすることができ

【0020】なお、前記焼結終了温度が内部導体の融点 未満の温度となると内部導体の表面性が良化する効果が 得られなくなり、一方内部導体の沸点をこえる温度とな ると内部導体が消失してしまう。また、焼成温度が内部 導体の融点未満の温度となると、セラミック材料が未焼 結のままであり、かつ内部導体溶融による効果が得られ ない。

【0021】前記の「焼結終了温度」は、図1に示すよ うな熱収縮曲線から求められるものである。図1に示す ように、温度の上昇に伴い、セラミック材料は、ある傾 向をもって熱膨張するが、ある温度になるとその傾向か らずれはじめる。熱収縮曲線におけるその点をAとす る。A点をすぎてセラミック材料は収縮しはじめ、一定 の割合で収縮しはじめる。一定割合で収縮する領域の最 低温側の点をBとする。また、一定割合で収縮する領域 の最高温側の点をDとする。さらに、収縮が終了し、体 積変化がほとんどないと考えられる領域のうち最低温側 の点をEとする。

【0022】そして、点Aにおける接線Iと点Bにおけ る接線IIとの交点Cを焼結開始温度、点Dにおける接線 III と点Eにおける接線IVとの交点Fを焼結終了温度T 20と定義する。

【0023】本発明の多層セラミック部品に用いる誘電

体セラミック材料としては、焼結終了温度が前記した条 件を満たすものであれば、本来どのようなものであって もよく、特に限定しない。しかし、例えば200MHz~ 1 OGHz 程度の周波数を扱う高周波用共振器等の誘電体 層として用いる場合、焼成して得られる誘電体セラミッ ク材料に窒化物や炭化ケイ素系のセラミック等を用いた 例は無い。また、窒化物や炭化ケイ素系のセラミックで は、それらの材料と内部導体として用いる銀や銅あるい はそれらを含む合金等の溶融金属との濡れ性が悪い。小 型化、薄層化する傾向にある多層セラミック部品ではそ 10 の内部導体層も厚さを薄く、さらに幅も狭くする必要性 が高くなっている。このような多層セラミック部品の焼 成に際し、濡れ性の悪いセラミック材料を用いた誘電体 セラミック層では内部導体層の断線等の欠陥の発生率が 高くなりやすい。そのため、誘電体セラミック材料とし ては、濡れ性がより高く、内部導体層の断線等の欠陥の 発生率が低い、焼成により酸化物または酸化物の混合物 となるものが好ましい。例えば後述する材料系を用いて 焼成して得られた複合酸化物や、一部にルチル構造等を 有する酸化物の混合物等である。本発明は、このような 20

誘電体セラミック材料を焼成して得られた、酸化物や酸

化物の混合物の誘電体セラミック層をもつ多層セラミッ

ク部品である。

【0024】本発明に用いる誘電体セラミック材料の具 体例としては、MgO-SiO2系、CaO-MgO-TiO2系、BaO-TiO2-SnO2系、BaO-MgO-CoO-Nb2 O5 系、BaO-Nd2 O3 -TiO2-Bi2O3-Al2O3-MnO系などが挙 げられる。MgO-SiO2系としては、2MgO・S i O₂ 30~95モル%、CaTiO₃ 50モル%以 下、SrTiO360モル%以下で、これら各酸化物の 合計100モル%に対し、MgOを0.1~10wt%、 La₂O₃をO.1~1Owt%添加したもの(特開昭4 7-21698号参照); CaO-MgO-TiO2系 としては、MgTiO3 70~100モル%、TiO2 0~30モル%で、これら各酸化物の合計100モル% に対し、CaTiO₃を1~9wt%添加したもの(特開 昭52-118599号);BaO-TiO2-SnO 2 系としては、BaO·x { (1-y) TiO2 ·yS nO_2 { $x = 4 \sim 4$. 5、 $y = 0 \sim 0$. 10] の組成 40 を有するもの(特公平4-32483号参照); BaO -MgO-CoO-Nb₂O₃ 系としては、BaO5 $MgOO. 1\sim 6. 5wt\%, Nb_2 O_6 31. 0\sim 3$ 4. 7wt%のもの(特開昭61-72676号参照); BaO-Nd₂ O₃ -TiO₂ -Bi₂ O₃ -Al₂ O 3 -MnO系としてはBaO9~18モル%、TiO₂ 65~73モル%、Nd2O314~19モル%で、こ れら各酸化物の合計100モル%に対し、Bi2O3を 3. 0~11. 0wt%、Al₂ O₃ を0. 1~2. 0wt 50 ₃ -Al₂ O₃ -Mn O系のものでは、Pb Oを20~

%、MnOを0.1~1.0wt%添加したもの(本出願 人による特願平3-327352号)である。このほ か、BaO-MgO-Ta₂O₅系、ZrO₂-SnO 2-TiO2系、PbO-CaO-ZrO2系、SrO -ZrO2-TiO2系、BaO-Sm2O5-TiO 2系、PbO-BaO-Nd2 O3 -TiO2 系、およ びLi₂ O-Na₂ O-Sm₂ O₅ -TiO₂ 系等も用 いることができる。

8

【0025】BaO-MgO-Ta2 O5 系としては、 例えばBay (Mg_{1-x} Ta_x) O₃、ただし0.28 ≦ x ≦ 0.39、0.98 ≦ y ≦ 1.00の組成式で示 されるものである。ZrO2-SnO2-TiO2系と しては、例えば(Zr_{1-x} Sn_x) TiO₄、ただし $0.1 \le x \le 0.3$ の組成式で示されるものである。P bO-CaO-ZrO2 系としては、例えば (Pb_{1-x} Ca_x) ZrO₃ 、ただし0.35≤x≤0.5の組成 式で示されるものである。SrO-ZrO2-TiO2 系としては、例えばSry (Zr_{1-x} Ti_x)O₃、た だし0≦x≦0.1、0.98≦y≦1.01の組成式 で示されるものである。BaO-Sm2O5-TiO2 系としては、xBaO-ySm2O5-zTiO2とし τ , 0. $1 \le x \le 0$. 2, 0. $1 \le y \le 0$. 2, 0. 6 ≦z≦0. 75のものである。PbO-BaO-Nd2 O3 - TiO2 系としては、xBaO-yNd2 O3 $z T i O_2 \ge U C$, 0. $0.2 \le x \le 0.25$, 0. 05 $\leq y \leq 0$. 41、0. 50 $\leq z \leq 0$. 82で、これら各 成分の合計に対し、さらにPbOを17wt%以下含有す るものである。Li2 O-Na2 O-Sm2 O5 -Ti O₂ 系としては、例えば(Lix Nay Sm₂) TiO 30 ₃ 、 $tilde{$ 35, 0. $15 \le y \le 0.$ 25, 0. $4 \le z \le 0.$ 60組成式で示されるものである。

【0026】また、上記の基本組成に加えて、さらに、 必要に応じ、MnO、CuO、ZnO、SnO2、Pb O、NiO、WO3、SiO2、B2O5およびNb2 Os等が添加されていてもよい。

【0027】また、上記の誘電体セラミック材料は、2 **0℃における比誘電率 (ε) が6.5~120、特に2** 0~120、誘電損失 (Q・f値) が3500~225 000、共振周波数温度係数 (τf) が-4.5~+ 8. 5 ppm/℃のマイクロ波誘電特性を有する。なお、 τ f は-40℃の共振周波数と80℃の共振周波数を結ん だ直線の傾きとして求めたものである。

【0028】本発明において、内部導体ペーストのパタ ーンを形成する絶縁性の誘電体セラミック材料層には、 前記の酸化物骨材を主成分とするセラミック材料を用い るが、このほか適宜ガラスを添加したものであってもよ い。添加ガラスは、酸化物骨材の構成によって異なる が、例えば、BaO-Nd2O3-TiO2-Bi2O

86. 5wt%、好ましくは30~84wt%、B2 O3 を 8. 5~21wt%、好ましくは9~19wt%、ZnOを 5~5 Owt%、好ましくは7~4 3wt%含有するガラス を用いることが好ましい。このようなガラスにおいて、 さらに、Al2 O3 および/またはSiO2 を含有して もよく、これらのものを含有するときの含有量は、A1 2 O₃ が2 Owt%以下、好ましくは0. 1~5wt%、S iO2が9wt%以下、好ましくは2~7wt%とするのが よい。

9

【0029】このような誘電体のセラミック材料は、焼 10 挙げられるが、特に印刷法が好ましい。 結前にビヒクルを加えてスラリーとされる。ビヒクルと しては、エチルセルロース、ポリビニルブチラール、メ タクリル樹脂、ブチルメタアクリレート等のバインダ、 テルピネオール、ブチルカルビトール、ブチルカルビト ールアセテート、アセテート、トルエン、アルコール、 キシレン等の溶剤、その他各種分散剤、活性剤、可塑剤 等が挙げられ、これらのうち任意のものが目的に応じて 適宜選択される。ビヒクルの添加量は、酸化物骨材とガ ラスの合計量100重量部に対し、65~85wt%程度 とすることが好ましい。

【0030】内部導体としては特に制限はないが、内部 導体層の直流での導電率が1×10⁵ Ω⁻¹cm⁻¹以上の導 体材料を用いることが好ましい。また導電率の上限には 特に制限はないが、通常 6. 2×10⁵ Ω⁻¹cm⁻¹程度で ある。

【0031】具体的には、銀(6.17×10⁵ Ω⁻¹cm -1)、銅(5. 81×10⁵ Ω⁻¹cm⁻¹)を用いることが 好ましい。より好ましい態様では、融点が960℃付近 の銀または融点1060℃付近の銅を用いる。この際、 銀あるいは銅の含有量が90wt%以上のもの、特に純度 30 99wt%以上、さらには99.9wt%以上の純銀または 純銅を用いることが好ましい。このように、特に純銀な いし純銅を用いることにより導電率の逆数である比抵抗 と損失とをきわめて小さくすることができ、共振器のQ 値を向上させることができる。

【0032】従って、銀の場合は、その融点である96 0℃以上の温度であって、かつセラミック材料の焼結終 了温度以上の温度で焼成することが好ましく、通常11 50~1750℃、さらには1200~1700℃の温 である1060℃以上の温度であって、かつセラミック 材料の焼結終了温度以上の温度で焼成することが好まし く、銀の場合と同様に通常1150~1750℃、さら には1200~1700℃の温度とすることが好まし

【0033】このような焼成温度でグリーンシート等の セラミック材料層と同時焼成することにより、本発明の 実効が顕れる。これは焼成温度が融点未満となって低く なりすぎると、本発明の実効が顕れないが、あまりに高 すぎると内部導体が蒸発により消失する。焼成は、銀の 50 ガラスフリットの他、ビヒクルが含まれる。ビヒクルと

場合には通常、空気中にて上記の温度で1分~1時間程 度、より好ましくは、5~20分程度行なうことが好ま しい。また、銅の場合には、通常、酸素分圧を 10^{-6} at m 以下に制御して行なう。なお、焼成は複数回行なって もよく、そのとき少なくとも1回は上記条件を満足する 融点以上の焼成とする。

【0034】内部導体パターンの形成方法としては、所 定形状の銀箔等を誘電体グリーンシートにはさむ、ある いは導体ペーストの印刷または転写を行なう等の方法が

【0035】導体ペーストにてパターンを形成する場 合、用いる銀粉、銅粉等の導体粉の平均粒径(異方性の ある時には長軸径)は、0.5~20μm程度、より好 ましくは1~5μmとするのが好ましい。粒径が小さす ぎると、分散性が悪くなり、導体ペースト中の導体粉の 含有量を多くすることができず、また含有量を多くする と粘度が高くなってしまい、緻密なパターンを形成でき なくなってくる。一方、粒径が大きすぎると、スクリー ン印刷、転写法等によるパターンの形成が困難となって くる。また、銀粉の形状等には特に制約はないが、一般 に球状とし、その一部または全部を鱗片状のものとして もよい。

【0036】内部導体ペースト中の導体粉の含有量は、 60~95wt%、特に70~90wt%とするのが好まし い。含有量が少ないと、比抵抗が減少し、Q値が低下 し、焼成後のパターンの一部が断線したり、比抵抗やQ 値がばらついたりしてくる。また大きすぎると、ペース トの粘度が増大し、パターン形成が困難となってくる。 【0037】また、内部導体のペーストにはガラスフリ ットを添加してもよく、特に導体粉融点付近に軟化点を もつガラスフリットを添加することが好ましい。このよ うなガラスフリットを添加することにより、溶融後の網 目構造の発生が減少し、Q値のバラツキを抑えることが できる。

【0038】特に、ガラスフリットの添加は平均粒径の 小さい微粉末の導体材料を用いたときに内部導体材料の 拡散を防止する上で、有効であり、比較的大径の導体材 料では拡散はそれほど問題とはならず、この場合はガラ スフリットの添加はしない方が好ましい。ガラスフリッ 度とすることが好ましい。また、銅の場合は、その融点 40 トを添加しない方が伝送線路の損失をさらに低減するこ とができる。

> 【0039】内部導体ペースト中のガラスフリットを添 加する場合、その含有量は、10wt%以下、特に1~1 Owt%、さらには3~8wt%が好ましい。また、ガラス フリットは、導体粉に対して10wt%以下、特に2~1 Owt%、特に4~6wt%、体積比では30体積%以下、 特に2~30体積%、さらには5~10体積%含まれる ことが好ましい。

【0040】内部導体ペーストには、銀粉等の導体粉と

しては、エチルセルロース、ポリビニルブチラール、メ タクリル樹脂、ブチルメタアクリレート等のバインダ、 テルピネオール、ブチルカルビトール、ブチルカルビト ールアセテート、トルエン、アルコール、キシレン等の 溶剤、その他各種分散剤、活性剤、可塑剤等が挙げら れ、これらのうち任意のものが目的に応じて適宜選択さ れる。ビヒクルの添加量は、ペースト中、10~20wt %程度とすることが好ましい。

【0041】内部導体ペーストの成膜方法は公知のスク リーン印刷法、転写法などによればよい。

【0042】また、本発明は、内部導体を融点の異なる 少なくとも2種の材料から形成し、内部導体のうち低融 点内部導体の融点以上で、しかも高融点内部導体の融点 未満の温度であって、かつセラミック材料の焼結終了温 度以上の温度で焼成してもよい。

【0043】この場合の低融点内部導体としては、上記 の銀、銅を用いることが好ましく、上記と同様の効果が 得られる。

【0044】一方、高融点内部導体に用いる導体として を用いればよい。ただし、低融点および高融点のそれぞ れの内部導体の融点の中間の温度で焼成を行なうので、 両者の焼成を良好に行なうためには、高融点内部導体に 用いる導体の融点は、低融点内部導体の融点に対し、3 0℃以上、特に50~200℃、さらには50~100 ℃高いものであることが好ましい。なお、高融点内部導 体としては、後述のように2種の金属粉、例えばAg粉 とPd粉を用い、これを焼成に際しAgの溶融を行なう ことなく合金化させることもできるので、このときに は、その融点とは合金の融点である。

【0045】このような高融点内部導体に用いる導体と しては、低融点内部導体の導体に銀を用いる場合、30 wt%以下、特に5~10wt%のPdを含むAg-Pd合 金が好適である。この場合、合金を用いるかわりに、A g粉とPd粉を混合して用いてもよい。これらを均一に 分散させれば、焼成に際して先ずAgとPdとの合金化 が進み、Agは溶融しない。この他、銀に対しては、1 00wt%以下、特に50~60wt%のAuを含むAg-Au合金; 20wt%以下、特に5~10wt%のPtを含 むAg-Pt合金;20wt%以下、特に5~20wt%の 40 とがある。 Pdを含むAu-Pd合金; 10wt%以下、特に5~1 Owt%のP t を含むA u - P t 合金;金;銅;25wt% 以下のAuを含むAu-Cu合金;20wt%以下のCu を含むAu-Cu合金;10wt%以下、特に5wt%以下 のPtを含むCu-Pt合金;25wt%以下、特に10 wt%以下のNiを含むCu-Ni合金等も使用可能であ る。さらに低融点内部導体に銅を用いるときには7~3 Owt%、特に10~20wt%のPtを含むAg-Pt合 金;2~20wt%、特に2~10wt%のPdを含むAu

含むAu-Pt合金;30wt%以下、特に15~20wt %のP tを含むCu-P t合金; 4 0wt%以下、特に2 0~30wt%のNiを含むCu-Ni合金等が使用可能

12

【0046】なお、高融点内部導体としては2種以上を 用いてもよく、場合によっては低融点内部導体を2種以 上用いてもよい。また、高融点内部導体は、その成分の 一部を溶融してもよい。ただし、低融点内部導体は実質 的にその全部を溶融する。

【0047】以上のような内部導体材料の融点以上の温 度で同時焼成する際の内部導体材料の詳細については、 本出願人による特願平4-134199号、特願平4-146478号に記載されている。

【0048】また、本発明では、用いるセラミック材料 あるいは導体材料によっては、焼成雰囲気の酸素分圧を 大気中の酸素分圧より低くして行なうこともある。例え ば導体材料として銀を用い、前記のようなガラスを添加 したセラミック材料を用いる場合、酸素分圧を5×10 -2atm 以下とすることが好ましい。これにより銀の薄層 は、低融点内部導体に用いる導体よりも融点が高い導体 20 化、ひいては消失を防止することができ、共振器として のQ値を高くすることができる。ただし、セラミック材 料のガラス成分の焼結を可能とするため、酸素分圧の下 限値は5×10⁻⁵atm とする。

> 【0049】さらに、内部導体材料として特に銀を用い る際、焼成時の酸素分圧を1×10⁻¹atm 以下、より好 ましくは5×10⁻²atm 以下、特に1×10⁻²atm 以下 とすることが好ましい場合がある。銀を内部導体材料と して用い、誘電体セラミック材料層と積層して焼成する 際、銀は、溶融時に雰囲気中の酸素を固溶することが知 られている。このとき銀に固溶した酸素は、溶融銀の冷 却固化時に酸素ガスとして放出される。この放出酸素ガ スは、内部導体層と隣接する誘電体セラミック層との間 の内圧を上昇させる原因となる。

> 【0050】このとき、隣接する前記誘電体セラミック 層の厚さが厚い場合には誘電体セラミック層のもつ機械 的強度も比較的高いため、実質的には問題が生じること は少ないが、放出酸素ガスの発生による内圧の上昇が原 因となり、内部導体と誘電体セラミック材料層との間に 空隙が生じたりして共振器のQ値の低下の原因となるこ

【0051】一方、焼成時に積層方向の最外層に誘電体 セラミック層を有し、内部導体層の前記最外層側の表面 から前記最外層表面までの距離 (図4に例示する t およ び/または t') が、焼成後500 μm 以下、さらに3 ΟΟμm 以下、特に200μm 以下である場合、前記放 出された酸素ガスによる内部導体層と隣接する誘電体セ ラミック層との間の内圧の上昇が原因で、隣接する誘電 体セラミック層と内部導体層とが剥離する事故が発生し やすい。この場合、剥離事故が発生しやすい部分である - P d 合金、2~2 0 wt%、特に2~1 0 wt%のP t を 50 積層方向の最外層の誘電体セラミック層は、積層方向上

下2ヶ所ある。このうち少なくとも一方の内部導体層の 最外層側の表面から最外層表面までの距離が前記以下の 場合、剥離による事故が発生しやすい。なお、前記誘電 体セラミック層の厚さは、通常40μm 以上で用いられ

【0052】このような場合、焼成時の酸素分圧を、前 記1×10⁻¹atm 以下、より好ましくは5×10⁻²atm 以下、特に 1×10^{-2} atm 以下とすることが好ましい。 すなわち、焼成時に積層方向の最外層にある前記誘電体 セラミック材料層の厚さが薄いほど、銀導体の冷却固化 10 時に放出される酸素ガスによる、導体と誘電体セラミッ ク層の間の内圧上昇の影響を受けて剥離が発生しやすい ため、誘電体セラミック材料層の厚さが薄いほど焼成時 の酸素分圧を低くすることが好ましい。

【0053】ただし、焼成時の酸素分圧を低くする場 合、前記した誘電体セラミック材料のうち、CaO-M gO-TiO2系、BaO-TiO2-SnO2系、B a O - N d₂ O₃ - T i O₂ - B i₂ O₃ - A l₂ O₃ -MnO系、ZrO2-SnO2-TiO2系、SrO -ZrO₂-TiO₂系、BaO-Sm₂O₅-TiO 20 機能するので通常外表面に、外部電極は設けない。 2 系、PbO-BaO-Nd2 O3 -TiO2 系、Li 2 O-Na2 O-Sm2O5 - TiO2 系、等は、焼成 時の酸素分圧が、1×10-⁴atm 以下では還元されやす くなる。誘電体セラミック材料が還元されると例えば共 振器等の部品を構成した場合、そのQ値が著しく低下す ることになる。このため、これらの組成の誘電体セラミ ック材料を用い、さらに焼成時に積層方向の最外層表面 と内部導体層の最外層側の表面との距離が前記500μ m 以下の構成をもつ多層セラミック部品は、1×10⁻⁴ atm を超え、1×10⁻¹atm 以下、より好ましくは5× 30 $10^{-2} \sim 1 \times 10^{-3}$ atm 、特に $1 \times 10^{-2} \sim 1 \times 10^{-3}$ atm の酸素分圧下で焼成することが好ましい。

【0054】また、特に銅を導体材料とする場合、前記 のように、通常は酸素分圧を1×10-6atm 以下に制御 して行なう。酸素分圧が高すぎると銅の酸化により内部 電極が消失してしまうことがある。

【0055】しかし、前記のように、誘電体セラミック 材料によっては酸素分圧を低下させると還元される材料 がある。このため、内部導体に銅を用いる場合は、酸素 分圧を低下させても還元されにくい材料を用いることが 40 好ましい。このような材料としては、MgO-SiO2 系、BaO-MgO-CoO-Nb2 Os 系およびPb O-CaO-ZrO2 系等が挙げられる。

【0056】本発明の多層セラミック部品は共振器とし てのQ値が高いものであり、誘電体の厚さ3mmの条件で 280~430程度のQ値が得られる。

【0057】本発明の多層セラミック部品として、例え ば積層型フィルターは、図2に示す構成のものであって よい。

であり、誘電体セラミック材料の素体11に、内部導体 21、22および23が図示のように間挿されたもので ある。

14

【0059】また、図3に示す構成のものであってもよ く、フィルター2は誘電体セラミック材料の素体11 に、内部導体25および26が図示のように並列に間挿 されたものである。

【0060】なお、図2、図3のいずれのフィルターに おいても、外表面は金属や絶縁材で被覆されている。

【0061】またさらに、図4に示す構成のものであっ てもよい。図4では、積層方向の最外層に誘電体セラミ ック層を有し、内部導体層27および29が前記積層方 向の最外層表面から500μm以下の距離に配置されて いる。このように、最外層の誘電体セラミック層の厚さ tやt'の少なくとも一方が、焼成後500μm以下 で、さらに内部導体層27や29に銀を用いる場合、前 記のように、最外層の誘電体セラミック層が内部導体層 27や29と剥離しやすくなる。なお、図4に示すフィ ルターでは、内部導体層27、29がシールド層として

【0062】このような積層型フィルターは、誘電体セ ラミック材料の仮焼粉を用いてドクターブレード法など によりグリーンシートを成型し、それに所定のパターン で内部導体材料のペーストをスクリーン印刷法などによ り印刷し、印刷したシートを積層して熱プレスにより熱 圧着し、脱バインダー後、内部導体の融点以上の温度で あって、かつセラミック材料の焼結終了温度以上の温度 で焼成して得ることができる。その後、必要に応じて外 部電極用ペーストを印刷し、外部電極を焼き付けするな どすればよい。このほか、印刷積層法によってもよい。 【0063】このようにして得られる積層型フィルター は誘電体の全体の厚さが0.5~4㎜程度である。また 内部導体の厚さは20~100μm 程度、幅は0.5~ 2㎜程度である。この際、厚さ50μm以下、さらに4 0 μm 以下のときに本発明の効果は倍加する。また、誘 電体セラミック層の厚さは、40~150μm 程度であ る。なお、本発明の多層セラミック部品は、通常200 MHz 以上、特に800MHz ~10GHz 程度の周波数帯域 で用いられる。

[0064]

【実施例】以下、本発明を実施例によって具体的に説明 する。

【0065】実施例1

表1に示す各々の組成で、仮焼、粉砕、スラリー調製 後、ドクターブレード法により150~200 um のグ リーンシートを成型し、それにAg導体ペーストをスク リーン印刷し、印刷したシートを積層熱圧着し、脱バイ ンダー後、表1に示す条件で焼成し、この焼成物に外部 電極用ペーストを印刷後、外部電極を銀焼き付し、図2 【0058】図2に示すフィルター1は2段フィルター 50 において、共振器を1段とした1/41共振器(サンプ

 ν A~I) を各々作製した(表 1)。このときの積層数は20層とした。

【0066】 $1/4\lambda$ 共振器においては、内部導体の厚さが 60μ m 、幅が2mであった。

【0067】また、誘電体の厚さは表1に示すように 3.0mとした。

【0068】全体の寸法は1/42(誘電体中における*

銀粉 (平均粒径 3 μm : 純度 9 9. 9 %以上) アクリル樹脂 (バインダー)

ターピネオール(溶剤)

【0071】さらに、上記のように作製した1/42共振器のフィルター特性はYHP8510ネットワークアナライザーで評価し、共振器としてのQ値を求めた。結果を表1に示す。

【0072】なお、上記における誘電体セラミック材料のグリーンシートの作製は、特開昭47-21698号、特開昭52-118599号、特開昭61-72676号、特公平4-32483号、本出願人による特願平3-327352号の方法などに準じて行なった。その際の仮焼条件は表2に示すとおりとした。

【0073】また、上記において、グリーンシートを作製するかわりに、円柱状に成型し、表2に示す焼成条件

*波長λの1/4)×5mm×3.0mmとした。

【0069】なお、上記において用いたAg導体ペーストは、以下に示す組成のものを三本ロールにより混合分散して得たものである。なお、表1にはAgの融点および導電率を示す。

16

[0070]

9%以上) 90wt%

2. 5 wt%

7. 5 wt%

として焼成し、サンプルを得た(サンプルNo. $1 \sim 8$)。これらのサンプルを $10\,\mathrm{mm}\,\phi \times 5\,\mathrm{mm}$ に加工したのち誘電体共振法にて誘電率(ϵ)、Q・f値を求めた。また $-40\,\mathrm{C}$ の共振周波数と $80\,\mathrm{C}$ の共振周波数を結んだ直線の傾きを求め、共振周波数温度係数(τ f)を算出した。結果を表2に示した。

【0074】さらに、各材料につき、200℃/時間の昇温速度における熱収縮曲線から焼結終了温度($^{\circ}$) および焼結開始温度($^{\circ}$) を求め、表3に示した。

0 [0075]

【表1】

罴

	サンプル 誘電体セラミック材料組 成	材質		母 体 성 科 融点 導電率 (Ω -¹can⁻¹)	温度	焼成条件 度時間	雰囲気	八板游布性 Q值	誘電体 厚さ
∀	2MgO·SiO ₂ -CaTiO ₃ -SrTiO ₃ (90£LM) (2£lM) (8£LM) -MgO - La ₂ O ₃ (1.5wtM) (1.5wtM)	Ag	2,096	960°C 6.17×10°	1230°C	i e	10分 大気中	338	3 🛅
M	$MgTiO_3-TiO_2 - GaTiO_3$ ($90\pm LK$) ($10\pm LK$) ($6.2wt$ %)	Ag	2,096	6.17×10 ⁶	1380°C	10分	大気中	418	380
υ	BaO - CoO - MgO - Nb ₂ O ₅ (58.8wt%) (4.8wt%) (2.6wt%) (33.8wt%)	Ag	2,096	6.17×105	1470°C	10	基本	390	3 22
Ω	$Ba0.x = \{ (1-y)Ti0z.ySn0z \} $ (x=4, 4, y=0.09)	Ag	D.096	6.17×10°	1360°C	103	九和	316	3.00
四	BaO - TiO ₂ - Nd ₂ O ₃ (14.7± l M) (70.0 t lM) (15.3 t lM) - Bi ₂ O ₃ - Al ₂ O ₃ - MrO (7.5wtM) (1.0wtM) (0.1wtM)	Ag	2,096	6.17×10 ⁵	1320°C	10	大気中	322	3.1
щ	Ba0 ·x [(1-y)Ti0 ₂ ·ySn0 ₂] (x=4, 4, y=0.09)	Ag	೨096	Ag 960℃ 6.17×10°	1360°C	105	1360℃ 10分 1×10-3 気圧 (02分圧)	368	3 111
5	Ba(Mg1/3 Taz/3)03	Ag	೩096	6.17×10^6	1670°C	105	10分大気中	420	300
H	(Zro. 8Sno. 2) TiO4	Ag	2,096	6.17×10°	1600°C	103	大気中	388	3 1
Ι	(Pbo. 63 Cao. 37) Zr03	Ag	2,096	6.17×10 ⁵	1450°C	165	大気中	300	3 1110

[0076]

【表2】

特開平	c	_	0	=	0	c	7	0
と は は は が と と と と と と と と と と と と と と と	h	_	7.	ה	7.	n	- 1	ਨ

	**************************************	1							
サンブル No.	誘電体セラミック材料 組成	仮 温度 (で)	仮焼条件 温度 時間 (で)	焼成条件 温度 時間 (で)	条件時間	3	Q·f (GHz)	τ f (ppm/°C)	19
.	1 2MgO·SiO ₂ -CaTiO ₃ -SrTiO ₃ (90tm) (2tm) (2tm) (8tm) (8tm) (15 tm) (1.5 tm) (1.5 tm)	1000	2時間	1230	105	7	13000	0	
7	$\begin{array}{lll} MgTiO_3-TiO_2-CaTiO_3 \\ (904) \mathcal{M}) & (104) \mathcal{M}) & (6.2 \text{wt} \%) \end{array}$	1100	3時間	1380	105	20	40500	0	
က	BaO - CoO - MgO - Nb ₂ O ₅ (58.8wt%) (4.8wt%) (2.6wt%) (33.8wt%)	1200	2時間	1470	105	33	70000	-4.0	(11)
4	BaO·x $[(1-y) \text{Ti} 0_x \cdot y \text{Sn} 0_x]$ (x=4, 4, y=0.09)	1100	2時間	1360	103	37	35000	+4.0	
വ	BaD - TiO ₂ - Nd ₂ O ₃ (14.7± M) (70.0± M) (15.3± M) - Bi ₂ O ₃ - Al ₂ O ₃ - MnO (7.5 M t M) (1.0 M t M) (0.1 M t M)	1200	2時間	1320	10%	93	4000	48. 0	
9	Ba(Mg1,3 Taz,8)03	1300	2時間	1670	103	21	220000	+4.0	20
7	(Zro. aSno. 2)TiO4	1200	2時間	1600	105	38	55000	0	竹用
8	(Pbo. esCao. sr) Zr03	1000	2時間	1450	105	110	3300	+13	- 0

[0077]

0

実

【表3】

22

表	3			

サンプル No.	誘電体セラミック材料 組 成	焼結終了温度 (昇温速度:2	焼結開始温度 00℃/hr)
1	2MgO·SiO ₂ -CaTiO ₃ -SrTiO ₃ (90th%) (2th%) (8th%) -MgO - La ₂ O ₃ (1.5wt%) (1.5wt%)	1 2 2 6°C	1141℃
2	MgTiO ₃ -TiO ₂ - CaTiO ₃ (90EN%) (10EN%) (6.2wt%)	1 3 5 7℃	1179℃
3	BaO - CoO - MgO - Nb ₂ O ₅ (58.8wt%) (4.8wt%) (2.6wt%) (33.8wt%)	1468℃	1306℃
4	Ba0·x $[(1-y)TiO_2 \cdot ySnO_2]$ (x=4.4, y=0.09)	1307℃	1172℃
5	BaO - TiO ₂ - Nd ₂ O ₃ (14.74/%) (70.04/%) (15.34/%) - Bi ₂ O ₃ - Al ₂ O ₃ - MnO (7.5wt%) (1.0wt%) (0.1wt%)	1282℃	1154°C
6	Ba(Mg _{1/3} Ta _{2/3})O ₃	1652℃	1523℃
7	(Zro. aSno. 2)TiO4	1580℃	1445℃
8	(Pbo. 83Cao. 37) ZrO3	1427℃	1281℃

【0078】表1の結果から明らかなように、本発明の 1/4 λ 共振器は高いQ値を示している。従来、誘電体 ターを作製する場合、内部導体材料を溶融しない温度で 焼成する必要があり、上記で用いているような高温焼成 用のものは用いることができないとされていた(特開平 3-290358号等)が、これを覆す事実が明らかに なった。

【0079】実際、例えば、特開平3-295856号 実施例6に開示された低温焼成用のセラミック材料(2 00℃/時間の昇温速度における焼結終了温度は925 ℃以下と推定される。)を用いるほかは同様にして、上 記と同様に1/4λ共振器を作製し、Q値を求めたとこ 40 ろ、本発明のものより明らかに低いQ値を示すことがわ かった。

【0080】実施例2

表1に示すサンプルE、HおよびIの組成を用い、図4 の構成をもつ共振器を、実施例1と同様にして焼成し た。ただし焼成雰囲気は、酸素分圧を表4に示すそれぞ れの条件とし、図4に示す表層の誘電体セラミック材料 層の厚さt, t'は焼成後200μmとなるようにし て、サンプルNo. 21~24、31~34および41 ~46を作製した。

【0081】さらに、サンプルEの組成を用い、焼成雰 囲気は酸素分圧を表4に示す条件とし、図4に示す積層 セラミック材料と導体材料とを同時焼成して積層フィル 30 方向表層の誘電体セラミック材料層の厚さ t, t'を、 焼成後400μm となるようにして、サンプルΝο. 2 5および26を作製した。

> 【0082】得られたそれぞれの焼成物の積層方向表層 の誘電体セラミック材料層の剥離状況を評価し、結果を 表4に示した。

> 【0083】次いで、剥離の認められなかったサンプル について、1/4λ共振器を作製した。このときの積層 数は、内部導体27と29との間で20層とした。1/ 4 λ 共振器においては、内部導体 2 8 の厚さが 6 0 μm 、幅が2mmであった。また、共振器部分の誘電体の厚 さは表1に示すように3.0mmとした。共振器部分の全 体の寸法は $1/4\lambda$ (誘電体中における波長 λ の1/4) ×5mm×3. 0mmとした。

> 【0084】得られたそれぞれの共振器のフィルター特 性を実施例1と同様にして測定し、結果を表4に示し た。また、剥離が認められた大気中焼成サンプル(N o. 21、25、31および41)の共振器のQ値のデ ータは、表1の同一誘電体セラミック材料のものを表4 に記した。

50 [0085]

【表4】

2 (比較) Bao -TiOs - Mados -	サンブル No.	誘電体セラミック材料組成	内部域体材料	統成對田氣 (酸素分圧) (atm)	内部は体と誘電体 セラミック材料層 との剥離の有無	共振器特性 Q值	セラミック 材料層厚さ t (μm)
(上校) Ra0 -TiO ₂ -Nd ₂ O ₃ -Ni ₂ O ₄ -Ni ₂ O ₅ -Ni ₂ O ₅ -Ni ₂ O ₅ -Ni ₃ O ₅	21(比	Ba0 (14.7€/%)		大気中	剥離発生	7	200
Harry Bad -TiO ₂ -Nd ₂ O ₃ -Bi ₂ O ₃ -Ai ₃ O ₃ -MnO Ag 1×10 ⁻⁴ Niller Nil	2 2	-TiO ₂ -Nd ₂ O ₃ -Bi ₂ O ₃ -Al ₂ O ₃ (70E/R) (15.3E/R) (7.5wtX) (1.0wtX)	Ag	1 × 1 0 -*	製器なし	Ø	200
(比較) BaO -TiO ₂ -NdaO ₃ -NdaO	23	-TiO ₂ -Nd ₂ O ₃ -Bi ₂ O ₃ -Ai ₂ O ₃ (70EM%) (15.3EM%) (7.5wt%) (1.0wt%)	A	1 × 1 0 - 4	割離なし	0	200
(比較) Ba0		BaO -TiOz -NdzOs -BizOs -AlzOs (14.740%) (7060%) (15.360%) (7.50t%) (1.00t%)	AB	1 × 1 0-4	剥離なし	9	200
Ba0 -Ti02 -Nde0a -Bi20a -MnO Ag 1×10 ⁻⁸ 別離なし 318 (14.754%) (7054%) (15.354%) (1.5wt%) (0.1wt%) (0.1wt%) (0.1wt%) (0.1wt%) (2.co. eSno. z) TiO4 Ag 1×10 ⁻⁸ 別離なし 384 (Zro. eSno. z) TiO4 Ag 1×10 ⁻⁸ 別離なし 352 (Zro. eSno. z) TiO4 Ag 1×10 ⁻⁸ 別離なし 352 (比較) (Zro. eSno. z) TiO4 Ag 1×10 ⁻⁴ 別離なし 140 (Pbo. esCao. sr) ZrO4 Ag 1×10 ⁻⁴ 別離なし 298 (Pbo. esCao. sr) ZrO4 Ag 1×10 ⁻⁴ 別離なし 298 (Pbo. esCao. sr) ZrO4 Ag 1×10 ⁻⁴ 別離なし 292 (Pbo. esCao. sr) ZrO4 Ag 1×10 ⁻⁴ 別離なし 292 (Pbo. esCao. sr) ZrO4 Ag 1×10 ⁻⁴ 別離なし 292 (Pbo. esCao. sr) ZrO4 Ag 1×10 ⁻⁴ 別離なし 298 (Pbo. esCao. sr) ZrO4 Ag 1×10 ⁻⁴ 別離なし 288 (Pbo. esCao. sr) ZrO4 Ag 1×10 ⁻⁶ 別離なし 281 281 (Pbo. esCao. sr) ZrO4 Ag 1×10 ⁻⁶ 別離なし 281	25 (比)	BBO -TiO ₂ -Nd ₂ O ₃ -Bi ₂ O ₃ -Al ₂ O ₃ (14.7£M%) (70EM%) (15.3£M%) (7.5wt%) (1.0wt%)	A 8	大気中	剥離発生	8	400
(比較) (Zro. aSho. z) TiO4 A g 大気中 剥離発生 338 (Zro. aSho. z) TiO4 A g 1×10 ⁻² 剥離なし 352 (比較) (Zro. aSho. z) TiO4 A g 1×10 ⁻³ 剥離なし 140 (比較) (Pbo. ssCao. zr) ZrO3 A g 1×10 ⁻⁴ 剥離なし 310 (Pbo. ssCao. zr) ZrO3 A g 1×10 ⁻⁴ 剥離なし 298 (Pbo. ssCao. zr) ZrO3 A g 1×10 ⁻⁴ 剥離なし 292 (Pbo. ssCao. zr) ZrO3 A g 1×10 ⁻⁴ 剥離なし 298 (Pbo. ssCao. zr) ZrO3 A g 1×10 ⁻⁶ 剥離なし 288 (Pbo. ssCao. zr) ZrO3 A g 1×10 ⁻⁶ 剥離なし 288	5 6	-TiO ₂ -Nd ₂ O ₃ -Bi ₂ O ₃ -Al ₂ O ₃ (70EAR) (15.3EAR) (7.5wtX) (1.0wtX)	Aß	1 x 1 0 -8	別離なし	-	400
(Zro. sSno. z) TiO4 Ag 1×10 ⁻² 剥離なし 352 2 (比較) (Zro. sSno. z) TiO4 Ag 1×10 ⁻³ 剥離なし 352 2 (比較) (Pbo. ss.Cao. zr) ZrO3 Ag 1×10 ⁻³ 剥離なし 140 2 (比較) (Pbo. ss.Cao. zr) ZrO3 Ag 1×10 ⁻³ 剥離なし 298 2 (Pbo. ss.Cao. zr) ZrO3 Ag 1×10 ⁻⁴ 剥離なし 298 2 (Pbo. ss.Cao. zr) ZrO3 Ag 1×10 ⁻⁴ 剥離なし 298 2 (Pbo. ss.Cao. zr) ZrO3 Ag 1×10 ⁻⁶ 剥離なし 298 2 (Pbo. ss.Cao. zr) ZrO3 Ag 1×10 ⁻⁶ 剥離なし 288 2 (Pbo. ss.Cao. zr) ZrO3 Ag 1×10 ⁻⁶ 剥離なし 281 2	31 (北東		A	大気中	剥離発生	3	200
(比較) (Zro. eSno. s) TiO+ Ag 1×10 ⁻⁸ 剥離なし 352 20 (比較) (Zro. eSno. s) TiO+ Ag 1×10 ⁻⁴ 剥離なし 140 20 (比較) (Pbo. escao. sr) ZrOs Ag 1×10 ⁻² 剥離なし 298 20 (Pbo. escao. sr) ZrOs Ag 1×10 ⁻⁴ 剥離なし 298 20 (Pbo. escao. sr) ZrOs Ag 1×10 ⁻⁶ 剥離なし 288 20 (Pbo. escao. sr) ZrOs Ag 1×10 ⁻⁶ 剥離なし 288 20 (Pbo. escao. sr) ZrOs Ag 1×10 ⁻⁶ 剥離なし 288 20	32			1×10^{-8}	野暦なし	∞	200
(比較) (Zro. sNo. z) TiO ₄ Ag 1×10 ⁻⁴ 剥離なし 140 20 (比較) (Pbo. ssCao. z+) ZrO ₃ Ag 1×10 ⁻⁴ 剥離なし 310 20 20 (Pbo. ssCao. z+) ZrO ₃ Ag 1×10 ⁻⁴ 剥離なし 298 20 (Pbo. ssCao. z+) ZrO ₃ Ag 1×10 ⁻⁴ 剥離なし 298 20 (Pbo. ssCao. z+) ZrO ₃ Ag 1×10 ⁻⁴ 剥離なし 292 20 (Pbo. ssCao. z+) ZrO ₃ Ag 1×10 ⁻⁴ 剥離なし 288 20 (Pbo. ssCao. z+) ZrO ₃ Ag 1×10 ⁻⁶ 剥離なし 281 20	33	(Zro. sSno. 2) TiO.		1 × 1 0 -8	密議なり	വ	0
(比較) (Pb. ssCao. sr) ZrOs Ag 大気中 剥離発生 300 20 (Pb. ssCao. sr) ZrOs Ag 1×10-* 剥離なし 298 20 (Pb. ssCao. sr) ZrOs Ag 1×10-* 剥離なし 292 20 (Pb. ssCao. sr) ZrOs Ag 1×10-* 剥離なし 288 20 (Pb. ssCao. sr) ZrOs Ag 1×10-* 剥離なし 288 20 (Pb. ssCao. sr) ZrOs Ag 1×10-* 剥離なし 281 20	34 (比	(Zro. sSno.		1 × 1 0 -4	受職なし		0
(Pbo. ssCao. sr) ZrOs Ag 1×10-² 剥離なし 310 20 (Pbo. ssCao. sr) ZrOs Ag 1×10-² 剥離なし 298 20 (Pbo. ssCao. sr) ZrOs Ag 1×10-° 剥離なし 288 20 (Pbo. ssCao. sr) ZrOs Ag 1×10-° 剥離なし 288 20 (Pbo. ssCao. sr) ZrOs Ag 1×10-° 剥離なし 281 20	41 (比較		Ag	大郑中	剥離発生	0	0
(Pbo.osCao.sr) ZrOs Ag 1×10-* 剥離なし 298 20 (Pbo.osCao.sr) ZrOs Ag 1×10-* 剥離なし 292 20 (Pbo.osCao.sr) ZrOs Ag 1×10-* 剥離なし 288 20 (Pbo.osCao.sr) ZrOs Ag 1×10-* 剥離なし 281 20	42	(Pbo. ssCao. sv) ZrOs	Aß	1×10-	受棄なし	-	0
(Pbo. ssCao. sr) ZrOs Ag 1×10-4 剥離なし 292 20 (Pbo. ssCao. sr) ZrOs Ag 1×10-6 剥離なし 283 20 (Pbo. ssCao. sr) ZrOs Ag 1×10-6 剥離なし 281 20	43	(Pbo. 03Cao. 37) ZrO3	AB	1×10-	剥離なし	6	0
(Pbo. esCao. sr) ZrOs Ag 1×10-* 剥削なし 288 20 (Pbo. esCao. sr) ZrOs Ag 1×10-* 剥削なし 281 20	4 4	(Pbo. es Cao. sr) ZrOs	Ag	1×10-4	剥離なし	6	0
6 (Pbo. osCao. sr)ZrOs Ag 1×10-e 剥離なし 281 20	45	(Pbo. ssCao. sr) ZrOs	A8	_	剥削なし	∞	0
	46	(Pbo. ssCao. sr) ZrOs	Ag	-	剥離なし	∞	0

【0086】表4の結果から明らかなように、焼成雰囲気の酸素分圧が本発明の範囲では剥離の発生がなく、焼成雰囲気の酸素分圧を大気中とすると剥離が発生している。また、焼成雰囲気の酸素分圧が1×10⁻⁴となる

用いた例では、共振器の特性が低下している。一方、誘電体セラミック材料としてサンプル I を用いた例では、焼成雰囲気の酸素分圧が $I \times 10^{-6}$ であっても共振器の特性の低下は認められない。

と、誘電体セラミック材料としてサンプルEおよびHを 50 【0087】なお、上記の本発明における誘電体セラミ

ック材料の焼結終了温度T20は、いずれも、Agの融点 +150℃以上の温度であり、また熱収縮曲線から求め た焼結開始温度(図1:点C)と焼結終了温度T₂₀(図 1:点F) との距離において点Cから80%のところに 相当する温度T20′(図1:点G)はAgの融点+50 ℃以上の温度であることが確認された。

【0088】実施例3

誘電体セラミック材料として、表1に示すサンプルA、 DおよびEを用い、それぞれの組成で実施例1と同様に g導体ペーストを用いてスクリーン印刷法により直線パ ターンを印刷した。印刷したシート上に、さらに、それ ぞれ同じ誘電体セラミック材料のグリーンシートを積層 熱圧着して脱バインダー後、焼成雰囲気中の酸素分圧を 1×10⁻²とし、他は表1に示すそれぞれの誘電体セラ ミック材料の焼成条件により焼成し、焼成体を得た。

【0089】焼成体のサイズは、縦56mm、横65mm、 厚さ400μmとした。また、Ag導体は、焼成体縦方 向に1焼成体あたり24本をほぼ等間隔で配置し、導体 の各直線パターンは、焼成後のサイズで長さ約46mm、 幅約1mm、厚さ約40μm となるように印刷した。な お、導体の印刷場所は、積層後外部に露出しない位置と

【0090】得られたそれぞれの焼成体(誘電体セラミ ック材料1組成あたり10個作製した)を透明ガラス板 上に置き、ガラス板下部から可視光源を照射して透過光 を目視による観察と常法による透過X線像の観察とを行 い、Ag導体の断線部分の有無を調べた。その結果、断 線部分はそれぞれの誘電体セラミック材料の試料につい て1焼成体あたり5~10ヶ所であった。

> 銅粉(平均粒径5μm:純度99.9%以上) アクリル樹脂(バインダー) ターピネオール (溶剤)

【0097】得られたそれぞれの共振器は、良好な共振 器特性(Q値)を示した。

[0098]

【発明の効果】本発明によれば、内部導体を緻密化し、 しかも表面性を良好にすることができ、かつ誘電率およ び誘電損失(Q・f)等に優れた誘電体セラミック材料 を用いることができ、この結果Q値等の特性の向上を図 40 す概略構成図である。 ることができる。さらに、焼成時に内部導体層と誘電体 セラミック層との剥離による不良品の発生や、内部導体 層の断線等の発生を減少させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】焼結終了温度の求め方を説明するための熱収縮

【0091】比較例1

誘電体セラミック材料として、平均粒径約1μπ の窒化 アルミニウム粉末用い、さらに焼結助剤としてCaO換 算で0.5wt%となる量の炭酸カルシウムを加え、バイ ンダー等とともにスラリーとしてグリーンシートを作成 した。Ag導体ペーストを用い、実施例3と同様のパタ ーンを同様に印刷し、さらに同じグリーンシートを積層 熱圧着して脱バインダー後、窒素ガス雰囲気中で温度1 600℃、10分焼成して焼成体を得た。なお、焼成体 してグリーンシートを成型し、それに実施例1と同じA 10 や導体のサイズ、導体のパターンや印刷位置等は実施例 3と同じとした。

26

【0092】得られた10個の焼成体について、実施例 3と同様にしてAg導体の断線部分の有無を調べた。そ の結果、断線部分は1焼成体あたり40~50ヶ所であ り、さらに断線まで至らないが、導体の幅が狭窄した部 分が多数認められた。

【0093】実施例3および比較例1より明らかなよう に、酸化物または酸化物の混合物を誘電体セラミック材 料として用いた場合、溶融金属との濡れ性の悪い窒化ア 20 ルミニウムを用いた場合と比較して、導体の断線事故発 生率が大きく低下する。

【0094】実施例4

内部導体材料として銅を用い、誘電体セラミック材料と して表1のサンプルA、CおよびIの組成を用い、焼成 雰囲気として酸素分圧を1×10⁻⁶としたほかは実施例 1と同様にして共振器を作成した。

【0095】なお、用いたCu導体ペーストは、以下に 示す組成のものを三本ロールにより混合分散して得たも のである。

30 [0096]

9 Owt%

2. 5 wt%

7. 5 wt%

曲線を示すグラフである。

【図2】本発明における積層型フィルターを模式的に示 す概略構成図である。

【図3】本発明における積層型フィルターを模式的に示 す概略構成図である。

【図4】本発明における積層型フィルターを模式的に示

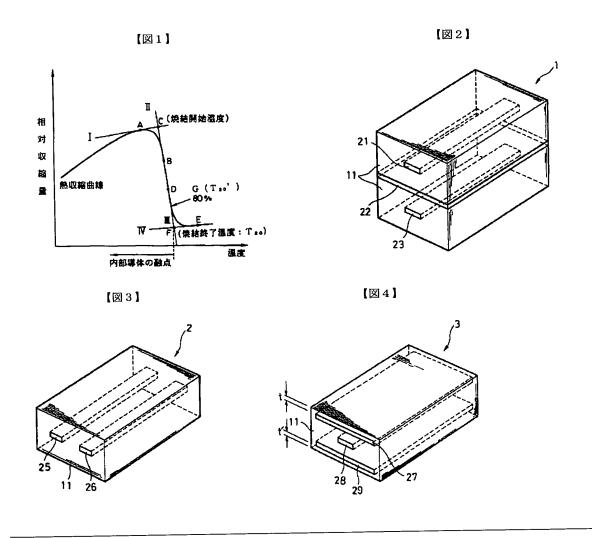
【符号の説明】

1、2、3 積層型フィルター

11 誘電体セラミック材料の素体

21~23、25~29 内部導体

技術表示箇所



フロントページの続き

識別記号 庁内整理番号 (51) Int. Cl. ⁵ H 0 5 K 3/46

H 6921-4E

FΙ

T 6921-4E

(72)発明者 川村 敬三 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ ーディーケイ株式会社内